

## 2010年夏の電子顕微鏡解析技術フォーラムのご案内

(社)日本顕微鏡学会・デバイス解析分科会  
事務局 (株)日鐵テクノリサーチ 水尾 有里  
mizuo@nstr.co.jp

拝啓

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。さて、8月20日(金)～21日(土)に開催致します「電子顕微鏡解析技術フォーラム」の詳細について下記のとおりご連絡致します。

敬具

### 1. 日時

2010年8月20日(金) 13:00～18:15, 18:30～20:00(懇親会)(受付開始 12:30～)  
2010年8月21日(土) 9:00～15:20(受付開始 8:40～)

### 2. 会場

国立女性教育会館 (埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 TEL. 0493-62-6723)  
HP: <http://www.nwec.jp/>  
研修棟 2階 大会議室(8/20), 201 会議室(8/21)

### 3. プログラム; 別紙をご参照下さい。

### 4. ざっくばらんトークについて

- (1) ざっくばらんトークでは、皆様に5分程度の話題提供を行ってまいります。特に発表者以外の参加者は、研究テーマ、仕事、日頃疑問に思っていることや自己紹介等、A4で1枚程度のPowerPoint ファイルにまとめて持参してください。発表者の方も大歓迎です。電子顕微鏡写真をご持参頂くと、より具体的な議論を行うことが可能です。PowerPoint ファイルはUSB メモリかご自身のPCでご持参ください。
- (2) 2日めは電子顕微鏡を用いた測長について討議予定ですので、情報や事例がありましたらご準備頂きたくお願い申し上げます。

### 5. 服装

カジュアルな服装(ネクタイ不要)で活発な議論をしたいと思います。

### 6. 宿泊

- (1) 同会場の宿泊棟になります。部屋割りは名簿でご確認ください。
- (2) 部屋に歯磨きセット、タオル、バスタオルは用意されていますが、浴衣の備え付けはございません。各自寝間着をご持参ください。浴衣は150円でレンタルできますので、必要な方は実行委員までご相談ください。
- (3) 入浴は大浴場で利用時間は17:30～22:30です。それ以降はC棟1Fと2Fにあるシャワールーム(24HOK)となります。

### 7. その他

プログラム内容によって会場が異なることがあり、多少の移動が必要です。特に20日は講演会場と懇親会場への移動が歩いて5～10分程度かかります。スケジュールがタイトなため、スムーズな移動にご協力をお願いいたします。詳細は添付の会場案内をご参照ください。

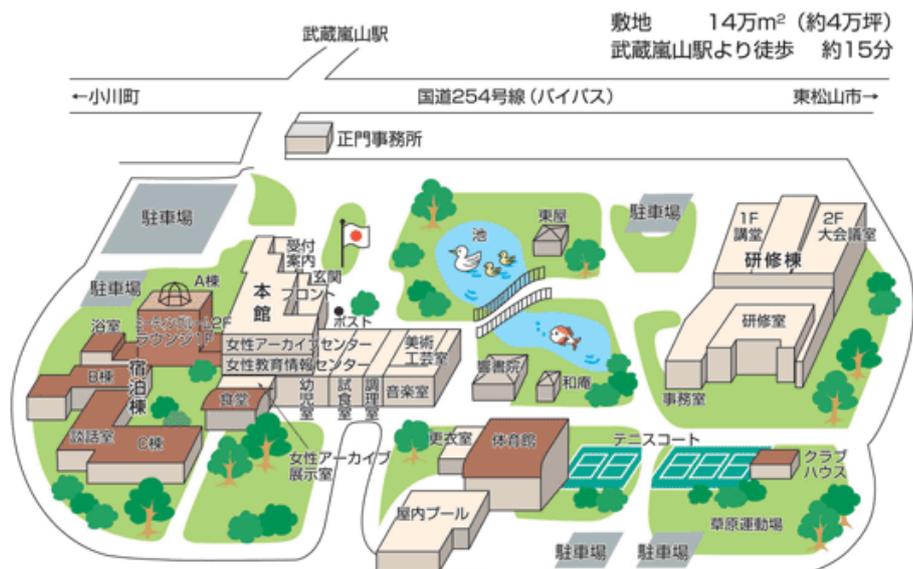
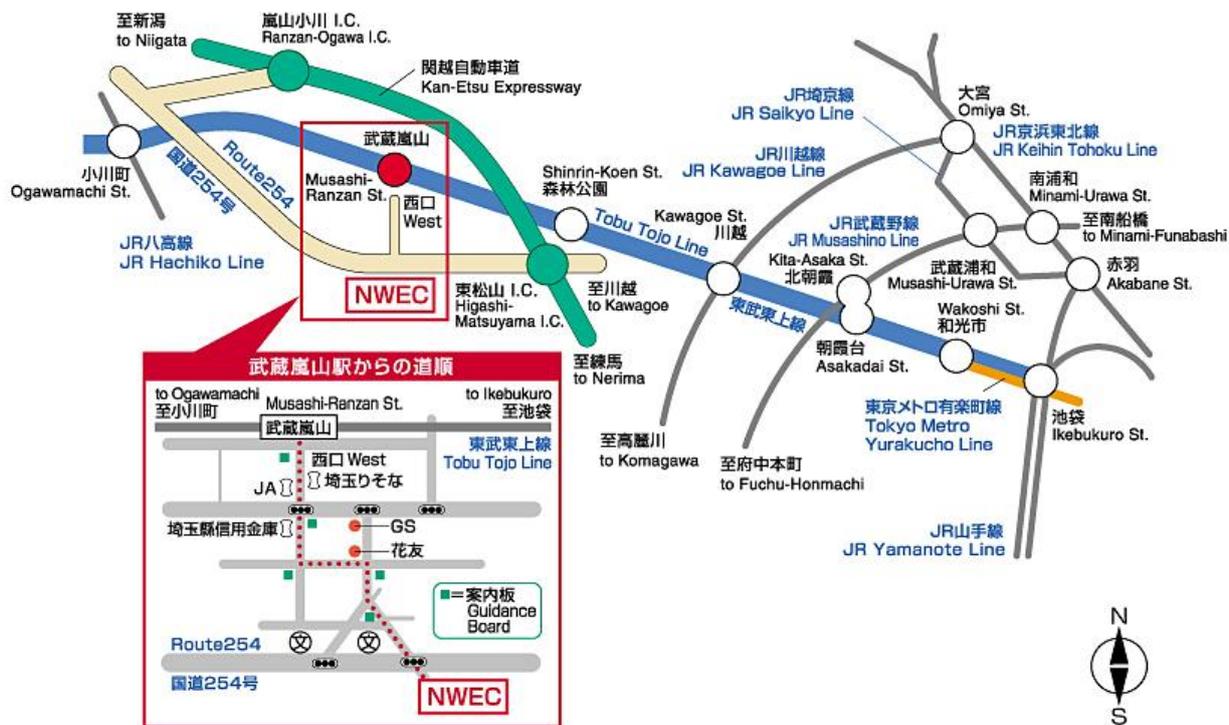
## 交通手段

### ○ 電車

東武東上線 武蔵嵐山駅から徒歩 15 分

タクシーを利用される場合は、ドライバーに「**国立女性教育会館 研修棟**」と教えてください。

※駅からのタクシー台数に限りがありますので、参加者間での相乗りにご協力ください。



以下の電車が便利です。

- ・ 東武東上線急行 小川町行き 11:21 池袋発 12:26 武蔵嵐山着
- ・ 東武東上線急行 小川町行き 11:36 池袋発 12:43 武蔵嵐山着

(社) 日本顕微鏡学会・デバイス解析分科会

## 2010年夏の電子顕微鏡解析技術フォーラムプログラム

### 8月20日(金)

12:30 受付開始

13:00-13:05 開会挨拶とオリエンテーリング

#### 「チュートリアル」

司会: 鈴木敏洋 (トプコンテクノハウス)

13:05-14:05 第一原理バンド計算, STEM/TEM, EELS を複合利用したデバイス材料解析 溝口照康 (東大)

14:05-15:05 電子チャネリングを用いたサイト選択的電子分光の進展 巽 一蔵 (名大)

15:05-15:15 休憩

#### 「ドーパント領域を見る」

司会: 加藤直子 (日本アイ・ビー・エム)

15:15-16:15 FIB-SEM による半導体拡散層の観察 新 一彦 (アイテス)

16:15-17:15 電子線ホログラフィーを用いた半導体の観察技術 佐々木宏和 (古河電工)

17:15-18:15 走査型プローブ顕微鏡によるキャリア分布可視化技術 小林 圭 (京大)

18:30-20:00 夕食と懇親会 司会: 元井泰子 (キヤノン)

#### 「ざっくばらんトーク I」(談話室)

司会: 乾 光隆 (セイコーエプソン)

21:00-22:30 ざっくばらんトーク 1 Q&A 全員参加

22:30-23:40 Free ざっくばらんトーク 自由参加

### 8月21日(土)

7:30-8:30 朝食

#### 「最近の半導体プロセス」

司会: 和田 充弘 (三井金属)

9:00-10:00 近年の Cu/Low-k 配線プロセス開発の現状と課題: TEM、そして HIM 小川真一 (産総研)  
(注) HIM はヘリウムイオン顕微鏡(Helium Ion Microscopy)の略称です。

10:00-10:10 休憩

#### 「一般講演」

司会: 長澤忠弘 (日本電子)

10:10-10:50 低角入射放射光トポグラフ法による SiC パワーデバイス内部構造の解析 松畑洋文 (産総研)

10:50-11:20 電顕データの定量解析: 歪み計測を中心として 石塚和夫 (HREM)

11:20-11:40 原子間力顕微鏡 (AFM) 用単結晶ダイヤモンド探針の先端形状の観察評価 中村新一 (青学)

11:55-12:50 昼食

#### 「ざっくばらんトーク 2」

司会: 石本竜二 (トクヤマ)

13:00-15:00 ざっくばらんトーク 2 電子顕微鏡の測長について考える 全員参加

15:00-15:20 総合討論と閉会の辞